

Установки отжига и термической обработки серии YES-PB-CP

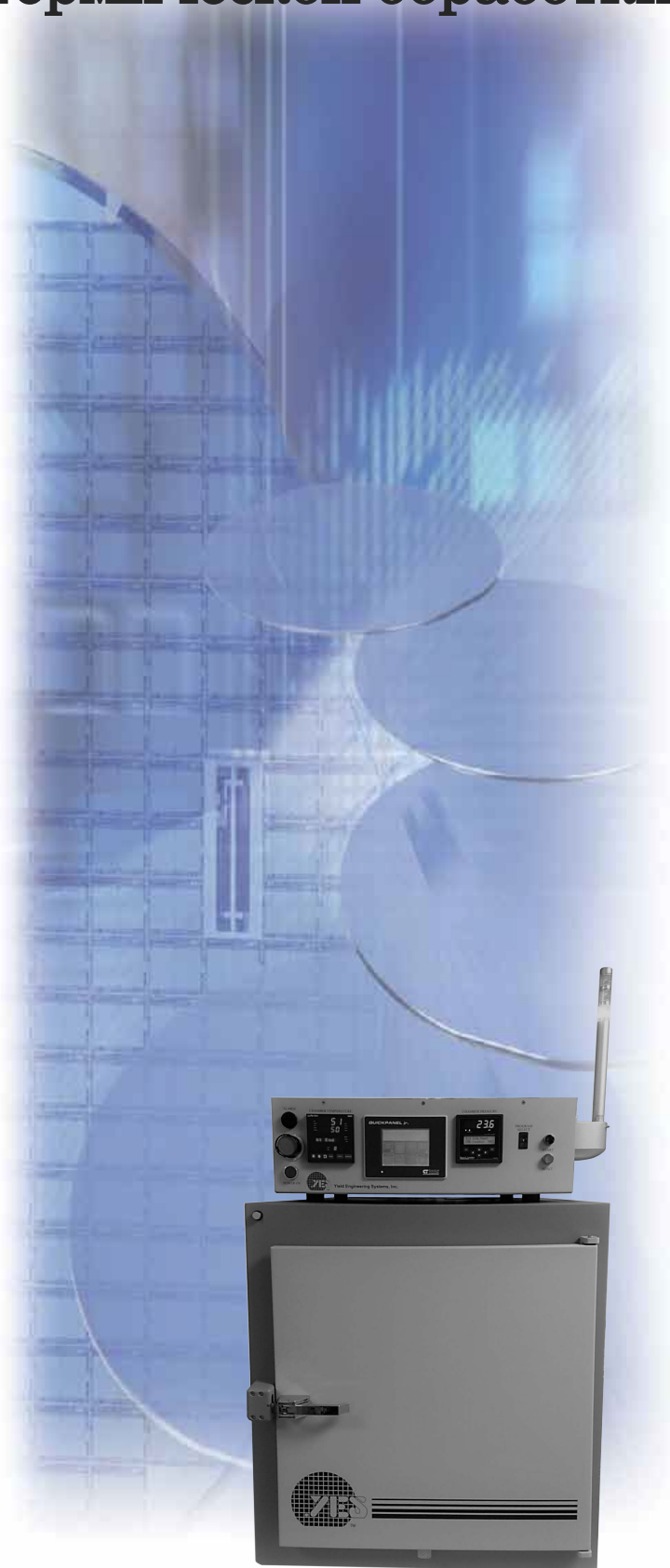
Установки YES-PB-CP предназначены для выполнения операций в наиболее требовательных технологиях микроэлектроники и микромеханики и обеспечивают высокое качество процессов корпусирования МИС на пластине, формирования микровыводов, отжига меди в полупроводниковых устройствах и др. Постоянное внимание к запросам Заказчиков и совершенствование систем позволяют гарантировать успешное применение установок для

- имидизации полиимида и бензоциклобутана
- вжигания алюминия и меди
- отжига пористых диэлектриков
- удаления оксида меди

Наиболее критичными для качества термических процессов являются: удаление паров растворителей из рабочего объема, однородность температуры в области обработки, контроль давления, минимизация содержания кислорода и паров воды в атмосфере камеры, контроль и управление скоростью нагрева и охлаждения. В конструкции установок YES-PB-CP учтены все перечисленные требования. Также предусмотрено снижение количества привнесенных частиц на поверхность подложек в процессе обработки.

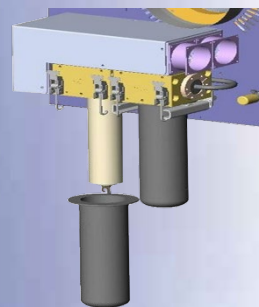
Серия YES-PB-CP включает несколько установок с одинаковыми конструктивными решениями, отличающихся размером и количеством загружаемых кассет с подложками (25 шт. в кассете).

Размер подложки	PB6-2P-CP	PB8-2P-CP	PB12-2P-CP
2" inch	4	9	25
3" inch	2	6	15
100 мм	2	3	10
125 мм	2	3	10
150 мм	2	3	10
200 мм	0	2	3
300 мм	0	0	2

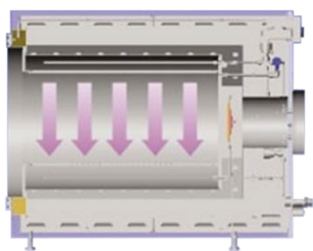


Конденсационная ловушка

Пары растворителей быстро конденсируются в областях с пониженной температурой, что может приводить к ухудшению работы вакуумного насоса, вакуумных клапанов и к осаждению нежелательных структур на вакуумных линиях. В установках YES-PB-CP используется конденсационная ловушка в линии вакуумной откачки для эффективного контроля процесса конденсации и простой утилизации отходов.



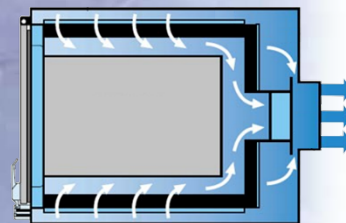
Технология ламинарного потока



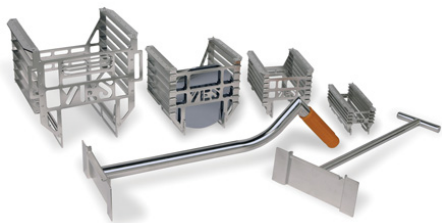
В установках YES-PB-CP применена технология вертикального потока газа в рабочей зоне технологической камеры. Подача и откачка инертного газа рассчитаны с учетом формирования ламинарного потока вдоль поверхности обрабатываемых подложек. В большинстве случаев это гарантирует практическое отсутствие привнесенных частиц на поверхность в процессе обработки.

Уникальная система охлаждения

Установки YES-PB-CP оснащены специальной системой охлаждения камеры для прецизионного контроля однородности и скорости охлаждения. Охлаждение производится воздушным потоком с возможностью регулирования соотношения потоков во внутренней и внешней части теплового экрана технологической камеры.



Кассеты для подложек



Для установок термической обработки и отжига компания YES предлагает специально разработанные, высококачественные кассеты из нержавеющей стали марки 316L с электрополировкой поверхности. Кассеты изготовлены сварным методом и не содержат разъемных соединений. Стандартная серия кассет полностью совместима с пластиковыми кассетами SEMI и может использоваться в любых установках технологического цикла без необходимости перегрузки подложек. Облегченная серия кассет Low profile обеспечивает дополнительное снижение тепловой инерции.

*Торговая марка Yield Engineering Systems и логотип Yield Engineering Systems - собственность Yield Engineering Systems, Inc.
Графика и дизайн - Yield Engineering Systems, Inc.
Перевод - АО "ВАКУУМ.РУ".*

*Информация в данном буклете представлена для ознакомления и не может являться частью контракта с АО "ВАКУУМ.РУ" или Yield Engineering Systems, Inc.
Точные характеристики оборудования согласуются при заказе.*

АО "ВАКУУМ.РУ"

Москва, Зеленоград
тел. +7 (495) 139-65-69
e-mail: sales@vacuum.ru
web: www.vacuum.ru